

報道関係者各位

IoT ビジネスを加速するセンシング×ネットワークの最新テクノロジーが一堂に！

「MEMS センシング&ネットワークシステム展 2020



MEMS SENSING & NETWORK SYSTEM 2020

株式会社 JTB コミュニケーションデザインは一般財団法人マイクロマシンセンター /技術研究組合 NMEMS 技術研究機構 共催にて 2020年1月29日（水） - 1月31日（金）の3日間、「MEMS センシング&ネットワークシステム展 2020」を東京ビッグサイトにて開催します。

次世代テクノロジー（自動車、5G、IoT、ロボット、バイオなど）に革新をもたらす、MEMS, センサ技術にフォーカスし機能性材料、次世代センサ、車載センサ、微細加工、薄膜、MEMS デバイスなど最新技術が集結します。

産学官・異分野融合のマッチングを加速させ、研究・開発/製造・設計者との質の高い商談を実現します。

同時開催全 15 展： All about Photonics (interOpto / LED JAPAN / Imaging Japan) / nano tech / TCT Japan / ASTEC / SURTECH / ENEX / Smart Energy Japan / 電力・ガスビジネス EXPO InterAqua / 新機能材料展 / JFlex / 3次元表面加飾技術展

報道関係者の皆さまへ>>> <https://www.optojapan.jp/mems/ja/press.html>

◆注目のセミナー

■オープニング特別シンポジウム MEMS 次世代テクノロジーフォーラム

次世代 MEMS 市場、そして数年先の技術が社会的・産業的に貢献するビジョンや方向性について、最新情報を発信します。

「バイオハイブリッドが拓く新産業創出に向けて」

東京大学大学院 情報理工学系研究科 知能機械情報学 専攻 教授 竹内 昌治先生

「赤外線イメージセンサーとその展開」

三菱電機株式会社 先端技術総合研究所 環境・デバイス技術部門 部門統轄 佐竹 徹也氏

「多様化する MEMS デバイスの開発」

ローム株式会社 研究開発センター副センター長 奥 良彰氏

「スマートセンシングが支えるデジタルトランスフォーメーション ～ものづくりのサービス化と人間拡張～」

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 人間拡張研究センター副センター長 牛島 洋史氏

■スマートセンシング&ネットワーク（SSN）研究会 公開シンポジウム

MEMS 協議会の SSN 研究会においては、スマートセンシングに関連する先端技術開発テーマの発掘・提案などの活動を、ワーキンググループ（WG）を中心に進めてきました。これまで実施してきた WG 活動から、今回は、超微小量センシングについて、ナショナルプロジェクト化された 2 件のテーマ紹介と医療・ライフサイエンスのプラットフォーム構築に有用なオリンパスのオープン API 構想について紹介します。

講演者：富山県立大学学長 下山 勲氏/ 東京医科歯科大学学生体材料工学研究所教授 三林 浩二氏/オリンパスフェロー 石井 謙介氏

◆注目の出展企業

▼日立ハイテクノロジーズ

国内初出展の小型リング装置、新型拡散ビーム装置を始め、圧電デバイス用のプラズマポーリング(分極処理)装置

▼産業技術総合研究所センシングシステム研究センター（2019年4月1日設立）は

産総研のセンサ・センシング技術を他の研究部門と併せて12小間で出展

▼三菱電機 <グラフェン光センサー技術>

防犯機器や空調機器、人数カウントソリューション、スマートビルディングなどの幅広い分野において、人・物の識別や行動把握を高精度に実現するサーマルダイオード赤外線センサ「MelDIR（メルダー）」や、グラフェンを用いた赤外線センサを含む様々な応用に向けた赤外線イメージセンサの開発技術について紹介

▼シチズンファインデバイス <マイクロ流体デバイス>

MEMS技術を用いたマイクロ流体デバイス（流路・ウェル・ピラー形状のチップ、及びSiマスタ金型）や、表面改質技術（親水・撥水制御）を用いた分析/検査チップ、細胞分離/細胞カウントや水晶を用いた質量センサ

▼SPPテクノロジーズ <シリコン深掘り(DRIE)装置>

SPPテクノロジーズは、MEMS・半導体製造に不可欠なSi深掘り装置(DRIE)のトップメーカーとして、新プラズマ源を搭載した最新鋭機「Proxion（プロキオン）」をはじめ、取扱装置に関する最新技術をご紹介します。また、トリオン・センサ社会で必要とされるミニマル装置から300mmウェハ対応装置をご提案します。

▼KOKUSAI ELECTRIC <縦型半導体製造装置>

世界TOPレベルの成膜技術を軸に、高品質な半導体製造装置を提供しております。室温～高温までの広い温度範囲と独自技術による高均一性、高被覆性、高品質のプロセスをご提供致します。

▼PICOSUN JAPAN <AGILE ALD>

MEMSデバイスの生産において近年特に重要視されている成膜技術であるALD（アトミックレイヤーデポジション）成膜装置

▼ポリテックジャパン <非接触計測センサ>

ものづくり・検査（品質管理）に必要な、変位・加速度・形状などのパラメータを、カラーマッピングアニメーションで可視化できます。MEMSや車載デバイス、アクチュエータなど各種デバイスは、非常に小さく、設計通りの駆動や、トラブルに起因する動作の確認には、質量負荷の影響のない、レーザ計測器が唯一のテストツールです。

▼富山県立大学 <MEMS五感センサ>

ヘルスケアのためのモニタリング・バイオメカトロニクス・ロボット制御のためのマイクロサイズの五感センサ

※展示内容は一部抜粋 ※順不同

全出展者一覧・セミナープログラムはこちらから>><https://www.optojapan.jp/mems/ja/>

◆開催概要

- 名称：MEMSセンシング&ネットワークシステム展2020
- 日時：2020年1月29日（水）～31日（金）10:00～17:00
- 会場：東京ビッグサイト西2ホール&会議棟
- 規模：出展者数：60社・団体、75小間（2020年1月16日現在）
- 予定来場登録数：50,000名 ※同時開催展含む

<本リリースに関する問合せ先>

MEMSセンシング&ネットワークシステム展事務局

株式会社JTBコミュニケーションデザイン 担当：瀧澤

〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング

TEL 03-5657-0768 E-MAIL mems@jtbc.com